

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ЛОТ №1

№	Атауы	Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Өлшем бірлік	Саны
1	Атомдық қабатты тұндыру технологияларында қолдануға арналған ионды тазалау және улау жабдығы (ALD)	LAD6 атомдық қабатты тұндыру (ALD) технологияларында қолдануға арналған ионды тазарту және улауға арналған жабдығы жұқа қабықшаларды қолданар алдында бетіндегі ластаушы заттарды жоғары дәлдікпен жоюды қамтамасыз ететін арнайы қондырғылар болып табылады. - <i>Өңдеу түрі</i>: ALD алдында пластиналарды дайындау үшін беттік иондық тазалау және улау. - <i>Иондардың энергиясы</i>: иондардың энергия диапазоны 50-ден 1500 эВ-қа дейін реттеледі, бұл улау процесінің талаптарына және субстраттың түріне байланысты. - <i>Макс. өңдеу температурасы</i>: 300°C-қа дейін. - <i>Ион көзінің түрі</i>: бетті тазарту және өңдеу үшін инертті газдар көзі (аргон). - <i>Улау</i>: ластануларды жою және жабынның адгезиясын жақсарту үшін бақыланатын иондық өңдеу. - <i>Жұмыс қысымы</i>: процестің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін $\pm 1\%$ дәлдікпен камераның қысымын 10^{-4}–10^{-6} Торр деңгейінде ұстау. - <i>Энергия беру жүйесі</i>: ион энергиясын реттеу мүмкіндігі бар жоғары дәлдіктегі плазманы басқару жүйесі. - <i>Өңделетін пластинаның өлшемі</i>: 6 дюймге дейін, ALD LAD6 сәйкестігі бойынша.	дана	1

№353/2024 жоба жетекшісі



Ж. Сағдолдина